

МОДЕЛИРОВАНИЕ НА ЦЭВМ ПРОЦЕССА ИОННОГО
РАСПЫЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

И.А.Константинов

Научный руководитель – доцент А.И.Меркулов

Самарский государственный аэрокосмический университет

Разработан пакет прикладных программ по моделированию на экране ЦЭВМ некоторых этапов процесса нанесения тонких пленок различных материалов методом ионного распыления: образование плазменного столба, разгон ионов, выбивание частиц материала из мишени (катода), пролет частиц и осаждение их на подложке. Моделируются также процессы распыления сложных соединений, образующихся на поверхности мишени или непосредственно в плазме.

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ПЛЕНОЧНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ МИКРОСХЕМ
НА ПРОГРАММИРУЕМОМ МИКРОКАЛЬКУЛЯТОРЕ

В.Д.Крушник

Научный руководитель – доцент В.Д.Дмитриев

Самарский государственный аэрокосмический университет

Приводится программа расчета конденсаторов на программируемом микрокалькуляторе, которая разделена на несколько этапов:

- расчет допусков на номиналы пленочных конденсаторов;
- расчет конструктивных параметров пленочных конденсаторов;
- расчет пленочных конденсаторов повышенной точности.